## Определение матричного элемента оператора квазиимпульса в бесщелевом полупроводнике HgSe методом эффекта поля в электролите

© О.Ю. Шевченко, В.Ф. Раданцев\*, А.М. Яфясов<sup>¶</sup>, В.Б. Божевольнов, И.М. Иванкив, А.Д. Перепелкин

Научно-исследовательский институт физики Санкт-Петербургского государственного университета,

198504 Санкт-Петербург, Россия

\* Уральский государственный университет,

620083 Екатеринбург, Россия

(Получена 30 мая 2001 г. Принята к печати 27 сентября 2001 г.)

Методом эффекта поля в электролите (измерялись вольт-фарадные и вольт-амперные характеристики) исследована система бесщелевой полупроводник HgSe–электролит (насыщенный раствор KCl). Предложен метод оценки величины матричного элемента оператора квазиимпульса P из ВФХ и найдено его значение при T = 295 K для HgSe.

Интерес к исследованию границ раздела в системах узкощелевых и бесщелевых полупроводников на основе двойных и тройных соединений теллуридов и селенидов ртути обусловлен, с одной стороны, использованием этих материалов для создания инфракрасных приборов в области прозрачности земной атмосферы [1], а с другой — при разработке квантовых интерференционных структур для наноэлектроники [2]. Во всех перечисленных областях успех применения указанных материалов в значительной степени зависит от технологий, позволяющих получать поверхность и гетероструктуры с низкой плотностью поверхностных состояний и с воспроизводимыми электрофизическими параметрами поверхности и приповерхностного слоя. Следует отметить, что если в отношении соединений на основе теллурида ртути к настоящему времени получена обширная и достаточно надежная информация, то в отношении соединений на основе селенидов ртути этого сказать нельзя. Весьма немногочисленный список исследований поверхностных свойств HgSe связан с методическими трудностями формирования на поверхности этого материала стабильных диэлектрических и пассивирующих покрытий. Это в свою очередь не позволяет в полной мере применить для исследования электрофизических свойств поверхности этих материалов большинство высокоинформативных традиционных методов, основанных на исследовании МДП структур или барьеров Шоттки.

Более того, можно также отметить, что и в литературе, посвященной исследованию объемных зонных параметров HgSe (как правило, такие данные относятся к низкотемпературным измерениям), также нет единого мнения (примером этого может служить недавняя дискуссия о характере зонной структуры HgSe [3–5]. Так, по данным работы [6] эффективная масса электронов  $m_e^* = 0.05m_0$  при T = 300 K при величине кейновской щели  $E_g = -0.2$  эВ, по [7]  $m_e^* = (0.015-0.019)m_0$ ,  $E_g = -0.2$  эВ, согласно [8]  $m_e^* = 0.019m_0$  при T = 95 K и  $E_g = -0.22$  эВ при T = 300 K, а по данным [9]  $m_e^* = 0.019m_0$ ,  $E_g = -0.22$  зВ при

T = 300 К. В работе [10] представлены данные для тройного соединения  $HgS_xSe_{(1-x)}$  при T = 300 К:  $E_g = -0.18$  эВ,  $m_e^* = 0.007m_0(x = 0.05)$ ,  $E_g = -0.2$  эВ,  $m_e^* = 0.008m_0(x = 0.1)$ . Значение матричного элемента оператора квазиимпульса для HgSe по данным работы [11] составляет  $P = 7.5 \cdot 10^{-8}$  зВ · см.

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования электрофизических свойств поверхности и приповерхностной области HgSe (определенная из Шубниковских осцилляций объемная концентрация электронов в исследованном образце  $n = N_A - N_D = 4.1 \cdot 10^{17} \,\mathrm{cm}^{-3})$  с использованием метода эффекта поля в электролите. Этот метод, ранее апробированный на многих полупроводниках [12], включая двойные и тройные соединения на основе теллуридов ртути [13,14], зарекомендовал себя как эффективный способ контроля и формирования сверхтонких диэлектрических покрытий, обеспечивающих исследования поверхности полупроводников в широком диапазоне изменений поверхностных потенциалов, включая область изгибов зон, соответствующих вырождению электронов и дырок на поверхности. В рамках такого метода может быть получена информация и о ряде зонных параметров полупроводника при комнатных температурах [15], измерение которых зачастую невозможно при использовании традиционных методов. Простота метода эффекта поля в электролите, не требующего изготовления МДП структур или (и) использования низкотемпературной техники, делает его весьма перспективным для неразрушающего экспрессконтроля параметров поверхности и приповерхностных слоев полупроводников.

Электрофизические и зонные параметры области пространственного заряда (ОПЗ) HgSe определялись из вольт-фарадных характеристик в системе HgSe — насыщенный водный раствор KCl. Одновременно с ВФХ, с целью контроля токов через межфазную границу полупроводник-электролит, измерялись вольт-амперные характеристики (ВАХ). Все измерения проводились в термостатированной при T = 295 К электрохимической

<sup>¶</sup> E-mail: yafyasov@desse.phys.spbu.ru



Экспериментальная вольт-фарадная характеристика системы HgSe-насыщенный раствор KCl.

ячейке. Поверхность образцов HgSe подвергалась механической полировке алмазной пастой и далее химикомеханической полировке в 8% растворе брома в метаноле, а непосредственно перед измерениями травилась в 2–8% растворе брома в метаноле. Измерения дифференциальной емкости осуществлялись на прямоугольном импульсном сигнале с длительностью тестирующего импульса  $\tau = 1$  мкс при циклической развертке электродного потенциала  $\varphi$  со скоростью 10–30 мB/с по методике, изложенной в [16]. Величина электродного потенциала измерялась относительно углеграфитового электрода.

Все измерения ВФХ проводились в диапазоне электродных потенциалов, для которого:

— ток через межфазную границу пренебрежимо мал, т.е. не было сколь-нибудь существенного вклада компоненты тока, обусловленной электрохимическими реакциями, протекающими при поляризации межфазной границы полупроводник–электролит в эффекте поля;

Физика и техника полупроводников, 2002, том 36, вып. 4

 ВФХ не изменяли своего вида при многократном циклическом изменении электродного потенциала (в течение нескольких часов);

— на межфазной границе HgSe-электролит отсутствуют поверхностные состояния, перезаряжающиеся в диапазоне времен релаксации, превышающих  $\tau \ge 10^{-5}$  с; - не наблюдалось насыщение емкости, которое бы свидетельствовало о формировании на поверхности HgSe оксида с толщиной, сопоставимой с длиной дебаевского радиуса экранирования в HgSe. Если такой слой и присутствует на поверхности полупроводника, то его толщина сопоставима с толщиной слоя Гельмгольца (т.е. менее 0.2-0.4 нм [12]) и заведомо меньше ширины ОПЗ. При соблюдении перечисленных условий все изменение электродного потенциала при развертке напряжения на ячейке приходится на ОПЗ HgSe  $(|\Delta \varphi| = |\Delta V_s|,$  где  $V_s$  — поверхностный потенциал), а измеряемая емкость есть непосредственно дифференциальная емкость ОПЗ полупроводника.

Как видно из рисунка, в области достаточно больших отрицательных электродных потенциалов (электронная ветвь ВФХ) на экспериментальной ВФХ отчетливо наблюдается выход на линейный участок. Нетрудно показать, что именно такая зависимость удельной емкости ОПЗ полупроводника и должна наблюдаться для кейновских полупроводников в области изгибов зон, превышающих величину кейновской щели  $E_g$ , причем наклон ВФХ непосредственно определяется величиной матричного элемента оператора квазиимпульса *P*. Действительно, для таких сильных изгибов зон закон дисперсии в относительно адекватном для узкощелевых и бесщелевых полупроводников двухзонном приближении

$$E = \sqrt{2P^2k^2/3 + E_g^2/4} - E_g/2$$

для большей части участвующих в экранировании электронов обогащенного слоя близок к линейному  $E \approx \sqrt{2/3}Pk - |E_g/2|$  [17], так что плотность состояний

$$D(E) = \frac{2}{(2\pi)^3} \int\limits_{S} \frac{dS}{\nabla_k E}$$

в зоне проводимости принимает вид

414

$$D(E) = (3/2)^{3/2} \frac{(E + |E_g/2|)^2}{\pi^2 P^3}$$

Здесь оставлены члены первого порядка по малому параметру  $E_g/2E$ ; dS — элемент изоэнергетической поверхности в пространстве квазиволнового вектора. Поскольку для рассматриваемого материала практически во всем обогащенном слое соблюдены условия сильного вырождения  $\mu_s \ge \mu \ge \mu_b \gg kT$  ( $\mu_s = eV_s + \mu_b$ ,  $\mu$  и  $\mu_b$  — энергия Ферми соответственно на поверхности, в ОПЗ и объеме полупроводника), для локальной концентрации носителей заряда имеем

$$n(\mu) = \int_{0}^{\mu} D(E)dE = (3/8)^{1/2} \frac{(\mu + |E_g/2|)^3}{\pi^2 P^3}.$$

В рамках такого приближения, адекватного в широкой области экспериментальных условий, для дифференциальной емкости ОПЗ

$$C = \frac{dQ_s}{dV_s},$$

где поверхностная плотность заряда в ОПЗ

$$Q_s = \varepsilon_0 \varepsilon_{sc} \left. \frac{dV}{dz} \right|_{V=V_s} = \left. \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_{sc}}{e} \left. \frac{d\mu}{dz} \right|_{\mu=\mu_s} \right.$$

( $\varepsilon_{sc}$  — статическая диэлектрическая проницаемость полупроводника) определяется первым интегралом уравнения Пуассона

$$\frac{d\mu}{dz}\Big|_{\mu=\mu_s}=\sqrt{\frac{2e^2}{\varepsilon_0\varepsilon_{sc}}}\left[\int_{\mu_b}^{\mu_s}n(\mu)d\mu\right]^{1/2},$$

после элементарных вычислений получаем следующую формулу:

$$C = \beta \frac{(eV_s + \mu_b + |E_g/2|)^3}{\sqrt{(eV_s + \mu_b + |E_g/2|)^4 - (\mu_b + |E_g/2|)^4}}$$

где

$$\beta = \sqrt{\frac{e^2 \varepsilon_0 \varepsilon_{sc}}{(2/3)^{1/2} \pi^2 P^3}}.$$

Разлагая последнее выражение для емкости в ряд по малому параметру  $(\mu_b + |E_g/2|)/eV_s$ , приходим к простому выражению

$$C \approx \beta \left( eV_s + \mu_b + |E_g/2| \right) \left[ 1 + \frac{1}{2} \left( \frac{\mu_b + |E_g/2|}{eV_s} \right)^3 \right]$$

Поскольку поправка, связанная с отклонением от квазиультрарелятивистского предела  $E_g = 0$ ,  $\mu_b = 0$  [17], возникает только в 3-м порядке по  $(\mu_b + |E_g/2|)/eV_s$ , вклад второго члена в скобках несуществен уже при относительно небольших изгибах зон и быстро падает с ростом  $V_s$ , и мы приходим к искомой линейной зависимости

$$C pprox eta(eV_s + \mu_b + |E_g/2|).$$

Производная  $dC/dV_s$ , измеренная в области линейного участка электронной ветви ВФХ, определяется только двумя материальными параметрами — матричным элементом оператора квазиимпульса Р и диэлектрической проницаемостью, что в конечном счете является прямым следствием ультрарелятивистского характера движения электронов в обогащенном слое, дисперсия которых  $E \approx \sqrt{2/3} Pk$  описывается одним параметром *P*. Используя экспериментальное значение  $dC/d\varphi = dC/dV_s$ для электронной ветви ВФХ (см. рисунок) и величину диэлектрической проницаемости  $\varepsilon_{sc} = 25.6$  из работы [6], находим, что для HgSe матричный элемент оператора квазиимпульса  $P = 8.2 \cdot 10^{-8}$  эВ  $\cdot$  см. Эта величина хорошо согласуется с данными, полученными в работе [11] для HgSe при низких температурах, и близка к значению *P* в HgTe.

В предположении, что нулевой электродный потенциал соответствует условию плоских зон  $\varphi_{fb} = V_s = 0$ , по потенциалу отсечки  $\varphi|_{C=0} = 0.220$  В при экстраполяции линейного участка ВФХ к C = 0 можно оценить величину  $\mu_b + |E_g/2|$ . Если использовать значение кейновской щели  $E_g = -0.220$  эВ из работ [8,9], то для энергии Ферми в объеме отсюда получаем  $\mu_b \approx 0.110$  эВ, что удовлетворительно согласуется со значением  $\mu_b = 0.095$  эВ, даваемым уравнением электронейтральности при использовании приведенных выше значений P,  $E_g$  и  $N_D - N_A$ .

Работа выполнена при поддержке грантов Министерства образования РФ № Е00-3.4-278 и Университетов России № 99-27-32.

Физика и техника полупроводников, 2002, том 36, вып. 4

## Список литературы

- P. Tribolet, J.P. Chatard, P. Costa, A. Manissadjian. J. Cryst. Growth, 184–185, 1262 (1998).
- [2] G. Nimtz, J.X. Huang, J. Lange, L. Mester, H. Spieker. Semicond. Sci. Technol., 6, C130 (1991).
- [3] K.-U. Gawlik, L. Kipp, M. Skibowski, N. Orlowski, R. Manzke. Phys. Rev. Lett., 78, 3165 (1997).
- [4] M. von Truchsess, A. Pfeuffer-Jeschke, C.R. Becker, G. Landwehr, E. Batke. Phys. Rev. B, 61, 1666 (2000).
- [5] D. Eich, D. Huebner, R. Fink, E. Umbach, K. Ortner, C.K. Becker, G. Landwehr, A. Fleszar. Phys. Rev. B, 61, 12666 (2000).
- [6] Таблицы физических величин. Справочник, под ред. И.К. Кикоина (М., Энергоиздат, 1991).
- [7] П.И. Баранский, В.П. Клочков, И.В. Потыкевич. Полупроводниковая электроника. Свойства материалов. Справочник (Киев, Наук. думка, 1975).
- [8] И.М. Цидильковский. Зонная структура полупроводников (М., Наука, 1978).
- [9] Б.М. Аскеров. Электронные явления переноса в полупроводниках (М., Наука, 1985).
- [10] И.И. Берченко, В.Е. Кревс, В.Г. Средин. Полупроводниковые твердые растворы и их применение. Справочные таблицы (М., Воениздат, 1982).
- [11] I. Stolpe, O. Portugall, N. Puhlmann, H.-U. Mueller, M. von Ortenberg, M. Von Truchsess, C.R. Becker, A. Pfeuffer-Jeschke, G. Landwehr. Physica B, 294–295, 459 (2001).
- [12] В.А. Мямлин, Ю.В. Плесков. Электрохимия полупроводников (М., Наука, 1965).
- [13] А.М. Яфясов, А.Д. Перепелкин, В.Б. Божевольнов. ФТП, 26, 636 (1992).
- [14] А.М. Яфясов, В.Б. Божевольнов, А.Д. Перепелкин. ФТП, 21, 1144 (1987).
- [15] А.М. Яфясов, В.В. Монахов, О.В. Романов. Вестн. ЛГУ. Сер. 4, 1, 104 (1986).
- [16] В.Б. Божевольнов, А.М. Яфясов. Вестн. ЛГУ. Сер. 4, 1, 18 (1989).
- [17] В.Ф. Раданцев. Письма в ЖЭТФ, 46, 157 (1987).

Редактор Л.В. Беляков

## Determination of the matrix element of the quasimomentum operator in the zero-gap semiconductor HgSe by field-effect method in electrolyte

J.Yu. Shevchenko, V.F. Radantsev\*, A.M. Yafyasov, V.B. Bogevolnov, I.M. Ivankiv, A.D. Perepelkin

Institute of Physics, Saint-Petersburg State University, 198504 St. Petersburg, Russia \* Ural State University, 620083 Ekaterinburg, Russia

**Abstract** By the field-effect in electrolyte method (the capacitance–voltage and current–voltage dependencies measured) a zero-gap semiconductor HgSe–electrolyte (KCl) system is investigated. A method of the estimation of matrix element of the quasimomentum operator via the capacitance-voltage dependencies is proposed and this value is found for HgSe at T = 295 K.